

**Результаты вступительного испытания Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике 16.08.2019  
(минимальный балл, необходимый для поступления на обучение - 40)**

<b>ID Абитуриента</b>	<b>Вступительное испытание</b>	<b>Балл</b>	<b>Тип Балла</b>
59527	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	90	Экзамен ЯрГУ
59035	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	90	Экзамен ЯрГУ
59057	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	89	Экзамен ЯрГУ
59526	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	89	Экзамен ЯрГУ
59181	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	88	Экзамен ЯрГУ
58613	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	87	Экзамен ЯрГУ
59182	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	80	Экзамен ЯрГУ
58573	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	80	Экзамен ЯрГУ
58909	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	75	Экзамен ЯрГУ
59395	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	65	Экзамен ЯрГУ
58611	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	63	Экзамен ЯрГУ
60103	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	50	Экзамен ЯрГУ
60419	Физические основы вакуумных и криогенных технологий в микро- и нанoeлектронике	45	Экзамен ЯрГУ